

放射線式 界面測定 線源容器FQG63

フレキシブル伸長エレメント付きの軽量線源容器



詳細情報と現在の価格は以下をご覧ください:

www.jp.endress.com/FQG63

利点:

- 線源カプセルの安全に関する規格では最も厳しい条件を満足 (DIN 25426/ISO 2919、分類C66646)
- 軽量で効率よく遮蔽ができる球面構造により信頼性の高い測定を実現
- 最大30m (98ft) の挿入長が選択可能であり、フレキシブルな設置が可能
- 手動での操作およびスイッチ位置の固定には南京錠、シリンダー錠または締付けボルトを使用
- スイッチ状態の確認が容易
- 取付が容易な小型機器；既存のタンクフランジに対応するアダプタおよびセンタリングフランジを使用

仕様一覧

- プロセス温度 最大 400°C (752°F) (ディップチューブ)
- プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット 制限なし (ディップチューブ)
- 主要接液部 非接触

アプリケーション: 線源容器FQG63は、放射線式レベル測定、密度測定および界面測定時に線源を格納しておくための容器です。線源容器がオフになっている間、放射線は全方向に遮断され減衰します。これにより、人員の高い安全性と測定の信頼性を確保します。線源がオンになりプロセスタンク内に挿入されると、全方向に放射線が照射されます。

機能と仕様

リミットスイッチ / 粉体

測定原理

放射線式リミットスイッチ

特性 / アプリケーション

Source container with flexible extension element to position the source inside the process vessel (diptube)

Approximately 87kg

Adapter flange: 10kg

特徴

アプリケーターによる管理区域計算

周囲温度

-52 °C...+200 °C

(-61 °F...+392 °F)

プロセス温度

最大 400°C (752°F) (ディップチューブ)

プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット

制限なし (ディップチューブ)

主要接液部

非接触

プロセス接続

非接触

サニタリ プロセス接続

非接触

連続 / 粉体

測定原理

放射線式

連続 / 粉体

特性 / アプリケーション

Source container with flexible extension element to position the source inside the process vessel (dip tube)

Approximately 87kg

Adapter flange: 10kg

特徴

アプリケーションによる管理区域計算

周囲温度

-52 °C...+200 °C

(-61 °F...+392 °F)

プロセス温度

最大 400°C (752°F) (ディップチューブ)

プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット

制限なし (ディップチューブ)

主要接液部

非接触

プロセス接続

非接触

連続 / 液体

測定原理

放射線式

特性 / アプリケーション

Source container with flexible extension element to position the source inside the process vessel (dip tube)

Approximately 87kg

Adapter flange: 10kg

特徴

フレキシブル伸長エレメント付き

連続 / 液体

周囲温度

-52 °C...+200 °C
(-61 °F...+392 °F)

プロセス温度

最大 400°C (752°F)

プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット
制限なし (ディップチューブ)

主要接液部

非接触

プロセス接続

非接触

リミットスイッチ / 液体

測定原理

放射線式リミットスイッチ

特性 / アプリケーション

Source container with flexible extension element to position the source inside the process vessel (dip tube)

Approximately 87kg

Adapter flange: 10kg

特徴

アプリケーションによる管理区域計算

周囲温度

-52 °C...+200 °C
(-61 °F...+392 °F)

プロセス温度

最大 400°C (752°F) (ディップチューブ)

プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット
制限なし (ディップチューブ)

リミットスイッチ / 液体

主要接液部
非接触

プロセス接続
非接触

密度

測定原理
放射線式密度測定

特性 / アプリケーション

Source container with flexible extension element to position the source inside the process vessel (dip tube)

Approximately 87 kg

Adapter flange: 10 kg

周囲温度

-52 °C...+200 °C

(-61 °F...+392 °F)

プロセス温度

最大 400°C (752°F) (ディップチューブ)

プロセス圧力 (絶対圧力)

制限なし

接液部

非接触

サニタリ

非接触

特徴

アプリケーションによる管理区域計算

詳細情報 www.jp.endress.com/FQG63